

テーマ：微細構造解析ツールとしての最先端SEM

「SEMで何がどこまで見えるのか？」

開催日時：平成21年12月11日（金）13:00～17:30

開催場所：物質・材料研究機構 千現地区「第二会議室」（つくば市千現1-2-1）

つくばエクスプレス「つくば駅」下車A3出口より徒歩15分

（会場付近の地図と交通アクセス：http://www.nims.go.jp/nims/office/tsukuba_sengen.html）

開催内容：

最近の走査型電子顕微鏡（SEM）の発展には目覚ましいものがあり、表面形状や平均組成だけでなく多くの結晶学的情報が得られるようになってきています。その反面、従来のSEM像コントラストの常識が通用しない場合も多くなっており、SEM像コントラストから有意な情報を正しく引き出す理論ならびに手法を確立することが重要になってきています。そこで今回は、最先端のSEM観察事例を中心に5つの講演を行なって頂き、参加者と共に「SEMで何がどこまで見えるのか？」についてインフォーマルに討論できる会を企画しています。

講演プログラム（予定）

1	13:00～14:00	基調講演「SEMの像形成モデルと物理挙動の考察」 ・SEM像の分解能、コントラスト、S/N、焦点深度の挙動 日立ハイテクノロジーズ(株) 研究開発本部 佐藤 貢
2	14:00～14:30	「イメージンレンズを用いた低エネルギー二次電子の選択」 ・ステージバイアス、ミラー電極によるコントラスト変化 日本エフイー・アイ(株) アプリケーションラボ 村田 薫
3	14:30～15:00	「大気圧走査電子顕微鏡クエアスコープとそのコントラスト」 ・新製品ClairScopeの動作原理とコントラスト形成メカニズム 日本電子(株) 経営戦略室 須賀 三雄
	15:00～15:15	休憩 & 懇談
4	15:15～16:00	「SEMによる半導体ドーパントコントラストの観察」 ・エネルギー選択した二次電子像の観察事例と像解釈モデル 住友電気工業(株) 解析技術研究センター 鶴見 大輔
5	16:00～16:45	「低加速SEMによる無機薄膜観察」 ・表面ポテンシャル、チャージングに基づく一考察 筑波大学 数理物質科学研究科 熊谷 和博
6	16:45～17:30	フリートーク & フリーディスカッション

参加費：無料

参加申込み（代表世話人）：九州大学大学院総合理工学研究院 板倉 賢

（Tel：092-583-7535, E-mail：itakura@asem.kyushu-u.ac.jp）

会場確保の都合がありますので、参加ご希望の方は、電子メールにて「①氏名、②所属、③連絡先」を11/30(月)までにご連絡下さい。